財団法人 JKA 2020 年度

超音波振動を援用した高アスペクト比

マイクロ加工に関する研究の補助事業

報告書

新潟大学教育学部金属加工研究室 平尾 篤利



目次

第1章	序論
1.1	放電加工法4
1.1.1	はじめに4
1.1.2	放電加工の原理5
1.1.3	パルス幅とピーク電流6
1.2	気泡の形成
1.2.1	単発放電加工における気泡の形成7
1.2.2	連続放電加工における気泡の形成8
1.3	超音波振動付与加工9
1.3.1	超音波振動の原理9
1.3.2	超音波振動を応用した様々な加工9
1.3.3	超音波振動付与放電加工9
1.4	本研究の目的10
1.4.1	本研究の背景および従来研究との関連性10
1.4.2	* 本研究の目的10
1.4.3	* 本論文の構成10
第2章	電極および振動子の振幅計測 11
2.1	緒言 11
2.2	実験装置・方法11
2.2.1	振動付与装置概要11
2.2.2	ランジュバン型振動子および銅電極12
2.2.3	5 ファンクションジェネレータ14
2.2.4	- 渦電流変位センサ15
2.2.5	オシロスコープ
2.3	実験結果および考察18
2.3.1	共振周波数測定 18
2.4	第2章結言
第3章	深穴放電加工における側面ギャップの観察

3.1	緒言	. 20
3.2	実験装置・方法	. 20
3.2.1	L 放電加工機	. 20
3.2.2	2 トランジスタ回路	. 25
3.2.3	3 制御システム	. 26
3.2.4	1 観察装置	. 31
3.3	実験条件および実験方法	. 37
3.3.1	気泡による加工屑排出効果	. 37
3.3.2	2 アスペクト比ごとの観察	. 38
3.3.3	3 気泡占有部比較	. 40
3.3.4	4 気泡の合一	. 41
3.3.5	5 放電波形	. 42
3.3.6	5 底面部と側面部の関係 超音波振動付与無し	. 43
3.4	結言	. 44
第4章	超音波振動付与放電加工	. 45
4.1	緒言	. 45
4.1.1	底面部と側面部の関係 超音波振動付与有り	. 45
4.2	実験装置・方法	. 46
4.2.1	超音波振動付与装置概要	. 46
4.3	実験結果および方法	. 48
4.3.1	電極に超音波振動付与	. 48
4.3.2	 加工液に超音波振動付与 	. 51
4.4	第4章 結言	. 52
第5章	回転電極放電加工	. 53
5.1	緒言	. 53
5.2	実験装置・方法	. 53
5.2.1	回転付与装置概要	. 53
5.3	実験結果および考察	. 56
5.3.1	回転電極実験結果	. 56

5.4	結言	59
第6章	結論	60
6.1	本研究のまとめ	60
6.2	今後の課題	62
参考文献		63

第1章 序論

1.1 放電加工法

1.1.1 はじめに

放電加工は,被加工物の硬度や靭性といった材料の特性に左右されない利点 がある.一方で,放電加工の問題点として,加工速度が遅いということがあげら れる.特に加工時間の短縮が望まれる現場では大きな課題となっている.

放電加工は、加工法によって分類することができ、一般的に知られているのは 形彫放電加工とワイヤ放電加工の2種類である.

形彫放電加工は,あらかじめ作製された特定形状の工具電極を用いて,その形状を被加工物に対して転写加工を行う加工法である.複雑な形状でも加工が可能であり,一般の機械加工では,切削できない超硬材,難削材に対しても加工できるという特徴がある.

ワイヤ放電加工は,直径が数十~数百[µm]の細いワイヤを工具電極に用いて, プログラムした軌跡に沿ってワイヤを走査し,糸鋸で加工したようなくり抜き 加工を行う加工法である.主に歯車加工や焼入れ部品の後加工など,ブロック加 工に用いられる.

本研究では、形彫放電加工について議論を進める.

1.1.2 放電加工の原理

図 1.1 に放電加工の原理を示す.以下に放電加工の原理について,簡単に説 明する.

放電加工は、水や油を加工液とし、加工液中で電極と被加工物を数[µm]~数+ [µm]まで接近させ、極間にアーク柱を発生させる.このアーク柱の熱的作用と加 工液の気化爆発により、溶融した被加工物を除去し、放電痕を形成させることを 繰り返して加工する.一発の放電によって加工物に形成される放電痕の大きさ は、材料の物性や加工時の電気条件などによって異なる.また、放電に使われる エネルギーが大きいほど大きくなり、表面粗さは悪化する.放電エネルギーとは、 パルス幅 t_e (放電が発生している時間) とピーク電流 i_e (極間に流れる電流)の 積によって表される.



1.1.3 パルス幅とピーク電流

図 1.2 に典型的な放電における電圧・電流の波形を示す. 放電における波形 は,主に4種類ある. 正常放電が理想的な放電における波形で,無負荷電圧がか かってから電流が流れる. 無負荷電圧とは,放電回路における電源電圧であり, 正常放電において負荷がかかっていない部分である. また,放電しない状態と同 じ電圧が出力される. 極間距離が広くなると放電することができず,反対に極間 距離が0[mm]になると短絡する. また,一発一発の放電が局所に集中すること を集中放電と呼び,高熱を持つ.



図 1.2 放電による波形

超音波振動を援用した高アスペクト比マイクロ加工に関する研究

1.2 気泡の形成

1.2.1 単発放電加工における気泡の形成

単発放電加工における気泡の形成についてまとめた. 図を図 1.3 に示す.

電極と被加工物が近づき,絶縁が破壊される.電極と被加工物はアーク柱で電 気的につながり,同時に,極間に存在する加工液が気化爆発を起こす.放電の時 間が続くと,気泡は大きくなり,被加工物表面および電極表面にエネルギーが投 入され,材料の融点を超えると溶け出す.設定した放電の時間が終了すると,そ の後気泡は収縮崩壊する.収縮崩壊時の気泡の運動により,溶けた部分は,被加 工物から引きはがされ,加工屑となり飛散する.気泡の崩壊が落ち着き,極間は 再び加工液で満たされる.吹き飛ばされた加工屑は,加工液の中に飛び散り,液 中に浮遊する.単発放電では,この(1)~(4)の流れを繰り返す.



図 1.3 単発放電における気泡の形成

1.2.2 連続放電加工における気泡の形成

連続放電加工における気泡形成についてまとめた. 図を図 1.4 に示す. 単発 放電の気泡形成と同様に,電極と被加工物が近づき,絶縁が破壊される. 電極 と被加工物はアーク柱で電気的につながる. 同時に,極間に存在する加工液が 気化爆発を起こす. 放電の時間が続くと,気泡は大きくなり,被加工物表面お よび電極表面にエネルギーが投入され,材料の融点を超えると溶け出す. しか し,連続放電では隣り合った気泡が合一し,極間に滞留する¹⁾. この極間に滞 留した気泡は,放電によって新たに形成された気泡と合一し,大きな気泡が形 成される. この時の放電加工の極間では約 70 パーセントが気泡で満たされて いるという報告されている²⁾³⁾. この合一された気泡の滞留により,加工液が 極間に流れ込まず,加工屑が加工面に付着したままとなる⁴⁾. このため,工具 電極と被加工物が加工屑により導通してしまう短絡現象や加工屑が同一箇所に 密集して発生する集中放電,異常放電が発生し,加工効率が低下すると考えら れている.



1.3 超音波振動付与加工

1.3.1 超音波振動の原理

超音波とは,一般に 20 [kHz]を超える「人間の可聴周波数以上の音域」と定 義されている.超音波は,電気エネルギーを振動のエネルギーに変えることで発 生させることができる.本研究では,ランジュバン型振動子を使用し,高速伸縮 を繰り返すことで超音波振動を発生させる.

1.3.2 超音波振動を応用した様々な加工

超音波振動を付与した加工法は、切削加工、研削加工、さらには遊離砥粒加工 などといった様々な加工に用いられている.超音波振動を付与したこれらの加 工法はすでに実用化されており、ダイヤモンドへの穴あけ加工など重要な位置 を占め研究されている.

1.3.3 超音波振動付与放電加工

放電加工には加工速度が遅いといった課題がある.この問題の解決策として, 工具電極や加工液に超音波振動を付与した放電加工が提案され,効果が確認さ れている ⁵⁾⁶⁾.

1.4 本研究の目的

1.4.1 本研究の背景および従来研究との関連性

放電加工の加工現象の解明を目的として、極間における気泡挙動に関する研 究が行われている.しかし、ほとんどが電極底面部の気泡の挙動観察であり、底 面部から抜け、側面部に現れた気泡については、詳細な観察がされていない.

1.4.2 本研究の目的

本研究では、アクリル加工槽とハイスピードマイクロスコープを用いて、深 穴放電加工時、超音波振動付与加工時における極間および側面ギャップの気泡 挙動の観察を行ったので報告する.

1.4.3 本論文の構成

ここでは、本論文の構成を説明する.本論文は第1章から第6章で構成されており、本論文の構成を示す.

第1章では、本研究の背景および目的を述べ、放電加工法について簡単に説 明する.

第2章では、実験装置の振幅計測を行った結果を示し、その結果および考察 について述べる.

第3章では,放電加工において極間および側面ギャップについて観察し,その結果および考察について述べる.

第4章では,超音波振動が極間および側面ギャップにおよぼす影響について 観察し,その結果および考察について述べる.

第5章では、回転電極が極間および側面ギャップにおよぼす影響について観察し、その結果および考察について述べる.

第6章では、本研究の結論を述べ、今後の課題について考察する.

第2章 電極および振動子の振幅計測

2.1 緒言

電極に超音波振動を付与すると電極が縦方向に振れる.このとき,電極の振幅が不安定であると,被加工物と電極が接触して短絡や異常放電が頻発する. そのため,ここでは安定した振幅を得るために,超音波振動が電極および振動 子の振幅に与える影響について調査する.

2.2 実験装置·方法

2.2.1 振動付与装置概要

超音波振動付与の流れを表したものを図 2.1 に示す.ファンクションジェネ レータからアンプに正弦波を送り、アンプを用いて、増幅する.アンプで増幅 した正弦波を振動子に送り、超音波振動を発生させる.渦電流変位センサを用 いることで電極の変位をオシロスコープによってモニタリングする.



図 2.1 超音波振動付与の流れ

2.2.2 ランジュバン型振動子および銅電極

ランジュバン型振動子の仕様を表 2.1 に示す. ランジュバン型振動子は, 駆動端子(+)とアース端子(-)に交流電圧を加えることで, 振動子が伸び縮みを繰り返して高速振動を起こし, 超音波振動を発生させる. 本研究で使用したランジュバン型振動子を図 2.2 に示す.

モデル	1540P2BF
直径	φ15 [mm]
全長	67 [mm]
周波数	40 [kHz]
測定電圧	10 [Vrms]
アドミタンス	10 [mS]

表 2.1 ランジュバン型振動子の仕様



図 2.2 ランジュバン型振動子

銅電極の仕様を表 2.2 に示す. 銅電極は, 振動子に1つのナットで固定する. その概略を図 2.3 に示す.

表 2.2 銅電	「極の仕様
----------	-------

全長	45 [mm]
直径	Φ3 [mm]
ねじ部	15 [mm]



2.2.3 ファンクションジェネレータ

電極に超音波振動を付与するために、ファンクションジェネレータを使用した. 図 2.4 にファンクションジェネレータを示し、その仕様を表 2.3 に示す.

IWATELI SG-4115 FUNCTION GENERATOR	15MHz
12.60 V 34.50kHz	REMOTE SWEEP BURST MODUL
AMP CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH	

図 2.4 ファンクションジェネレータ

•••	
モデル	SG-4115 (IWATSU)
発振電圧	50 [mV] ~ 10 [V]
発振周波数	10 [mHz] ~ 15[MHz]
発振モード	CONT , TRIG , GATE
周波数確度	±10 [ppm]
備考	BURST 可

表 2.3 ファンクションジェネレータの仕様

2.2.4 渦電流変位センサ

超音波振動付与による,銅電極の振幅は極めて微小である.そのため,本研究 では,高い分解能と精度での測定が可能である渦電流変位センサを用いて計測 する.表 2.4 に渦電流変位センサの仕様を示す.

メーカ	LION PRECISION
型式	ECL101
レンジ	50 ~ 500 [µm]
感度	10 [mV / μm]
分解能	12.7 ~ 12.9 [nm]
ターゲット	銅 (Cu)

表 2.4 渦電流変位センサの仕様

本研究で使用した渦電流変位センサおよび原理を図 2.5 に示す.過電流変位 センサでは,電界ではなく,磁界を使用してターゲットまでの距離を検知する. センシングコイルに交流が流れることで検知が始まり,これによって,コイルの 周囲に交流磁場が発生する.この交流磁場が導電性ターゲットと相互作用する と,ターゲットの材料に過電流と呼ばれる電流が発生する.この過電流が,セン シングコイルの磁場と対立する,独自の磁場を生成する.

このセンサは、センシングコイルの周囲に一定の磁場を作るように設計され ており、ターゲットでの過電流は検知フィールドとは反対であるため、元の磁界 を維持するために、センサはセンシングコイルへの電流を増加させる. ターゲッ トのプローブからの距離が変化すると、磁界を維持するために必要な電流の量 も変化する. センシングコイルの電流が処理されて出力電圧が発生し、プローブ に対するターゲットの位置を検知する. また、今回は銅 φ3[mm]であるため、感 度は 20[mV/ µm]となる. その際に読み取った波形を図 2.6 に示す.



図 2.5 渦電流変位センサおよび原理





2.2.5 オシロスコープ

オシロスコープを使用し、モニタリング検証を行う. 図 2.7 に使用したオシロスコープを示し、表 2.5 にその仕様を示す.



図 2.7 オシロスコープ

LeCroy
WaveSurfer 3024
4
200 [MHz]
4[GS / s]

表 2.5 オシロスコープの仕様

2.3 実験結果および考察

2.3.1 共振周波数測定

ファンクションジェネレータに出力を1[V]に固定し,20~100 [kHz]の周波数 を付与し,オシロスコープで読み取れる変位の変化が大きい周波数を調査した ところ37・44・64 [kHz]付近で確認した.これらの結果をもとに3つの周波数付 近の値±1 [kHz]の範囲で,ヒステリシスを考慮し,低周波から高周波にのみ周波 数を 0.05 [kHz]づつ動かす動作を行い,振幅の変位を読み取った.測定結果を 図 2.8 に示す.図 2.8 より,37[kHz],64[kHz]付近と比較し,44[kHz]付近の 振幅が 1.5~2.1[µm]と安定している.そのため,以降の実験では,44[kHz]付近 の周波数を選択する.これは、ランジュバン型振動子の共振周波数が40[kHz]で あるため,安定かつ最大の振幅が得られたと予想される.



2.4 第2章結言

本章では、渦電流変位センサを用い、超音波振動を付与した実験装置の電極および振動子の振幅測定を行った.本章で得られた内容を以下にまとめる.

- (1) ファンクションジェネレータの電圧を1[V]に固定し、共振周波数測定を行ったところ37・44・64[kHz]近傍で大きな変位が確認された.
- (2) 振幅の変位は、44[kHz]近辺で最大で2.1[µm]と確認された.

第3章 深穴放電加工における側面ギャップの観察

3.1 緒言

ここでは、放電加工において穴深さが側面ギャップにおける気泡、加工屑にお よぼす影響について調査した.

3.2 実験装置·方法

3.2.1 放電加工機

図 3.1 に本研究で使用する実験装置の概略を示す.赤枠の電気回路については 3.2.3 項にて,記載する.



図 3.1 実験装置概略

本研究で使用する放電加工機を図 3.2 に示す.本加工機は、ステッピングモ ータを用いて Z 軸を制御している. Z 軸ステージの最小分解能が 4 [µm]である ため、4 [µm]の微細制御が可能である.加工槽はアクリル製の箱型のものを使用 し、中心には被加工物を固定するための精密デバイスを設置している.また、静 電浄油機によって油の放出と吸引を同時に行い、油を流動させている.電極には、 2.2.2 節で示したものを使用する.被加工物には、SUS304 φ3 を用いた.



図 3.2 放電加工機

以下に,(1) 被加工物,(2) 静電浄油機,(3) XY 軸ステージ,(4) Z 軸ステージ の仕様を示す.

(1) 被加工物

本研究で使用した SUS304 を図 3.3 に示し,その組成を表 3.1 に示す. SUS304 は耐食性,溶接性,機械的性質が良好材料である.



図 3.3 SUS304

表 3.1 SUS304の組成

	C[%]	Si[%]	Mn[%]	P[%]	S[%]	Ni[%]	Cr[%]
SUS304	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	8.00~	18.00~
	以下	以下	以下	以下	以下	10.50	20.00

(2)静電浄油機

本研究で使用した静電浄油機を図 3.4 に示し、その仕様を表 3.2 に示す.



図 3.4 静電浄油機

モラ	デル	EDC-R3P(株式会社クリーンテック)		
消費	電力	200 [W]		
寸法 (L×W×H)		245×340×530 [mm]		
重量		20 [kg]		
	ISO 粘度 / 32	400 [ℓ]		
浄油対象油量	46	280 [l]		
	56	230 [ℓ]		
	68	190 [ℓ]		

(3) XY 軸ステージ

XY 軸ステージおよび使用しているステッピングモータの仕様を表 3.3 に示 す.

ステージ				
モデル	MMU-60X(中央精機)			
移動量	±10 [mm]			
分解能	1 [µm / パルス]			
送りネジリード	0.5 [mm]			
位置決め精度	0.02 [mm]			
繰り返し精度	± 0.001 [mm]			
ステッピングモータ				
モデル	PH553-NB (Orientalmotor)			
静止角度誤差	± 5 [min]			

表 3.3 XY 軸ステージの仕様

(4) Z 軸ステージ

Z軸ステージの仕様を表 3.4 に示す.

モデル	SGSP26-150 (SIGMAKOKI)		
移動量	150 [mm]		
分解能	4 [µm / パルス]		
送りネジリード	2 [mm]		
位置決め精度	0.015 [mm]		
繰り返し精度	6 [µm]		

表 3.4 Z 軸ステージの仕様

3.2.2 トランジスタ回路

本研究で使用するトランジスタ回路の概略を図 3.5 に示す.また,トランジ スタ回路で使用した n-MosFET の仕様を表 3.5 に示す.

FET (Field Effect Transistor)は、電源から送られた電圧をスイッチングする 素子である. 放電加工における電気回路は、トランジスタ回路およびコンデンサ 回路がある. トランジスタ回路による放電は、1.1.3 項の図 1.2 で示した正常放 電の波形となる.



図 3.5 トランジスタ回路概略

表 3.5 n-MosFET の作

モデル	K1519
定格電流	30 [A]
ターンオン時間	235 [nsec]
ターンオフ時間	615 [nsec]

3.2.3 制御システム

図 3.1 の※1について, 電極昇降の制御システムにおける電子回路の概略を 図 3.6 に示す.



図 3.6 電子回路概略

① 分圧

極間にかける電圧を利用するが、100 [V]の電圧をそのままかけると回路への付加が大きく壊れてしまうので、可変抵抗を用いて 10 [V]へ電圧を分圧する.

② バッファ

分圧した電圧を信号とし、その信号を主軸制御へ送る.

③ ローパスフィルタ

放電の入力波形は高周波であるため、ステッピングモータに直接入力がで きない. ローパスフィルタでは、遮断周波数より高い周波数を遮断し、波形 を低周波化(平均化)することで、ステッピングモータが読み取れる波形にし て出力する.

ステージの応答速度は数十[Hz]なので,遮断周波数は数十[Hz]に収める必要がある.遮断周波数は以下の式により求められる.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (3.1)$$

ここでは, R=100 [kΩ], C=0.047 [µF]を用い, 遮断周波数を約 33 [Hz]に 設定している.

極間電圧と基準電圧を比較し、FPGA ヘデジタル信号として送る.

④ コンパレータ

電子回路から送られた信号は, FPGA (Field Programmable Gate Array)を 用いて, PC の制御プログラム(Lab VIEW)で制御する.

FPGA とは、プログラマブルロジックデバイスの一種であり、製造後にユー ザーの手元で内部論理回路を定義・変更することができる集積回路である. プロ グラマブルロジックデバイスの中で、特に再書き換え可能であるものを FPGA と呼ぶ.

本研究で使用した,NATIONAL INSTRUMENT 社製の NI cRIO-9030 を図 3.7 に示す.これはデジタル信号,アナログ信号の入出力が可能である.



図 3.7 NI cRIO-9030

制御プログラム(LabVIEW)のフロントパネルを図 3.8 に示し,そのブロッ クダイアグラムを図 3.9 に示す.

基準電圧とは、主軸を制御する時の閾値である. 閾値より極間電圧が高い場 合に主軸を降下し、低い場合に主軸を上昇させるプログラムを組むことで、極 間距離の制御を行っている. このプログラムを用いて、極間距離を広く維持し たい場合は基準電圧を高くし、逆に狭く維持したい場合は基準電圧を低く設定 する.

パルス幅(ON)は放電時間を意味し,パルス幅(OFF)は休止時間を意味する. 本研究では,パルス幅および休止時間を5[µsec]に設定している.

	表示(V) ノロシ	エクト(P) 操作(0 9-	JU(1)	973	212(vv)	
수 & 🖲	18pt アプリケー	ションフォント	• +	•0••	₩ ₩ ₹	-0	2	
フままりの丁								
アイソパル	ス電極極	题性 +						
分开 : 1/10	1/20 1/25							
1/20 300→1	00V 300→100V	FET 条件						
1/20 150→2	00V 150→200V	100V 基準電	<u>∓</u> 60∨					
1/25 120→2	50V 120→250V	45V 基準電	±20V					
310	310							
基準電圧								
基準電圧	アイソパルス							
All produced and second second	1							
- 60 V	7 60 V							
60 V AO0 AI0	7 60 V A01							
)60 v AO0 AI0 パルス幅	√ ⁶⁰ v A01 V/F設定(あまりいじら	ない)					
利60 V A00 AI0 パルス幅 ON	√ ⁶⁰ v A01 V/F設定(調整83	あまりいじら	ない)					
160 AO0 AI0 バルス幅 ON 分5	v 60 AO1 V/F設定(調整83 分 50	あまりいじら 不感帯幅 く 1000	ない)					
() 60 AO0 AI0 バルス幅 ON 分 5 OFF	v/F設定(阿整83 分 50	あまりいじら 不感帯幅 分 1000 2000	ない)					
60 A00 A10 パルス幅 ON 分 5 OFF 分 5	→ ⁶⁰ × A01 V/F設定(調整83 分50	あまりいじら 不感帯幅 1000 2000	ない)					
00 A00 A10 バルス幅 ON 5 OFF 5 5	→ 60 A01 V/F設定(調整83 分 50	あまりいじら 不感帯幅 1000 2000 2000	ない)					
00 A00 A10 バルス幅 0N 分 5 0FF 分 5	→ 60 A01 V/F設定(調整83 分 50	あまりいじら 不感帯幅)1000 2000 2000	ない)					
00 AI0 V バルス幅 ON 分 5 OFF 分 5 0FF 分 5 0FF 分 5 1↓	A01 V/F設定(III III III III III III III III III III III II III II III III III III II II II III	あまりいじら 不感帯幅 う 1000 2000 2000	ない)					
60 A00 AI0	→ 3000 A01 V/F設定() 同整83 50	あまりいじら 不感帯幅 う 1000 2000 う 2000	ない)					
 60 v AOO AIO バルス幅 ON 5 OFF 5 5 	→ 3000 A01 V/F設定(50 3000	あまりいじら 不感帯幅 う 1000 2000 う 20000	ない)					
 60 AI0 V AO0 AI0 V	↓ 0 ∨ V/F設定 (: 回整83 ↓ 50 0 ↓ × 3000 × × × 0000/8 0 ↓ 0 モータ/じレス幅 ↓	あまりいじら 不感帯幅)1000 2000)20000	ない)					
 ○ 60 AOO AIO ∨ バルス幅 ○ N ○ 5 ○ FF ○ 5 参考値 1∨ AIO入力 ○ 絶対値後 ○ 	↓ 60 ∨ × × 1 × 1 1 → 3000 50 × 3000 1 × 3000 1 × 3000 1 × 3000 1 × 3000 1 × 3000 1	あまりいじら 不感帯幅)1000 2000 2000	ない)					
 60 AI0 V AO0 AI0 V	↓ 60 ∨ × × 1 □ □ □ □ □ □ → 3000 × × 3000 × ↓ □ □	あまりいじら 不感帯幅 〕1000 2000 〕20000	ない)					

図 3.8 LabVIEW フロントパネル



図 3.9 LabVIEW ブロックダイアグラム

3.2.4 観察装置

図 3.10 に本研究で使用する観察部の装置の概略を示す.



図 3.10 観察部概略

以下に,(1) ハイスピードマイクロスコープ,(2) カメラユニット,(3) マクロ ズームユニット,(4) アクリル加工槽の仕様を示す.

(1) ハイスピードマイクロスコープ

本研究で使用したハイスピードマイクロスコープを図 3.11 に示し,その仕様 を表 3.6 に示す.



図 3.11 VW-9000

表 3.6 VW-9000の仕様

メーカ	KEYENCE
型式	VW-9000
1千 米五	ハイスピード
種類	マイクロスコープ

(2) カメラユニット

本研究で使用したカメラユニットを図 3.12 に示し,その仕様を表 3.7 に示 す.



⊠ 3.12 VW-600C

メーカ			KEYENCE			
型式				VW-600C		
種類				高速カメラ	ユニット	
	30[fps]			10000[fps]	640×192	
B	$60[\mathrm{fps}]$		12000[fps]	0000/0040		
最 大 12	$125[\mathrm{fps}]$			15000[fps]	320×240	
解 像	$250[\mathrm{fps}]$			23000[fps]	320×160	
度 500[fps]		640×480		35000[fps]	256×128	
動面	動 面 1000[fps]			57000[fps]	160×112	
[保 左	2000[fps]			80000[fps]	160×80	
行時	4000[fps]			120000[fps]	100 × 40	
6000[fps]		640 imes 320		150000[fps]	160×42	
	8000[fps]	640×240		230000[fps]	160×32	

表	3.7	VW-600C	の仕様
---	-----	---------	-----

(3) マクロズームユニット

本研究で使用したマクロズームユニットを図 3.13 に示し,その仕様を表 3.8 に示す.



図 3.13 VW-Z2

メーカ			KEYENCE			
	型式			VW-Z2		
	種類			マクロズームユニット		
			D:2000	284.4[mm]		
	倍率	観察距離 WD:1000		136.2[mm]		
視 野	WIDE 侧 (×1)	観察距離V	VD:500	64[mm]		
サイ	(~1)	観察距離V	VD : 200	19.9[mm]		
- ズ H	体委	観察距離 W	'D:2000	71[mm]		
横	倍率 	観察距離 W	'D:1000	34.4[mm]		
2		観察距離 WD:500		16[mm]		
	(~4)	観察距離V	VD : 200	5[mm]		

表 3.8 VW-Z2 の仕様

(4) アクリル加工槽

本研究で使用した加工槽を図 3.14 に示す.一辺 10[mm],長さ 50[mm]のア クリルの角棒に φ5[mm],深さ 3[mm]の加工槽を製作した.加工槽の中心部に は、放電ギャップを考慮し、φ3.1[mm]の貫通穴をあけた.またマイクロスコー プの光を反射させるためにアルミホイルを巻いた.φ3.0[mm]の被加工物を用い ているため、φ3.1[mm]の穴では、放電加工の際、加工屑が隙間に沿って下に流 れ出てしまった.そこで、被加工物の側面にセメダインを塗ることで、隙間を埋 めた.



図 3.14 観察用加工槽

放電加工条件を表 3.9 に示す.

超音波振動付与の周波数および振幅の条件を表 3.10 に示す.

X 0.0	
電源電圧	100 [V]
放電電流	4 [A]
パルス幅(ON)	5 [µsec]
休止時間(OFF)	5 [µsec]
工具電極(+)	Cu φ3
被加工物()	SUS304 φ3
加工液	EDF-K2

表 3.9 加工条件

表	3.10	周波数および振幅条件

表 3.10 周波数	周波数および振幅条件	
周波数	振幅[µm]	
44[kHz]	2	

3.3 実験条件および実験方法

3.3.1 気泡による加工屑排出効果

ここでは、側面ギャップにおいて気泡が加工屑排出へおよぼす影響を観察した.図 3.15 に、超音波振動付与無しの側面ギャップでの気泡の観察結果を示す. 電極の位置は、図 3.14 に示した深さ基準線から 3[mm]としている.また、各図 に示した時間は、時間 t からの経過時間である.加工屑は気泡の境界に多く存在 していることが確認された.気泡は、膨張しながら動き、加工屑をより外側に押 し出し、気泡周囲に加工屑を蓄積する.一方、図 3.15(4)に示すように、気泡上 部において、気泡が抜けると加工屑も抜けていく.これは、加工屑排出において、 気泡が大きな役割を果たしているといえる.蓄積した加工屑を気泡とともに排 出することで、加工効率および加工精度を向上させることが期待される.





(3) t+0.04s

) **U** · 0.0****D



(4) t+0.06s

図 3.15 気泡による加工屑排出効果

3.3.2 アスペクト比ごとの観察

深穴放電加工(L/D=5 以上の穴加工)における側面ギャップの気泡挙動を観察 した.図 3.16 に,超音波振動付与無しで,アスペクト比ごとの側面ギャップの 観察結果を示す.L/D=1 では,図 3.16 右上から気泡の排出が確認できた.極間 および側面ギャップに気泡の滞留は見られない.L/D=2,L/D=3 では,図 3.16 左上から気泡の排出が確認された.しかし,極間および側面ギャップに気泡の滞 留が確認された.L/D=4 においては,(2)t+0.07s で図 3.16 左上から気泡が排出 したのち,気泡排出が繰り返されることなく極間および側面ギャップに気泡が 滞留してしまった.L/D=5 では,ハイスピードマイクロスコープで観察可能な 時間の間,一度も気泡の排出を確認することはできなかった.実際の加工におい て,L/D=5 を超えると加工効率が著しく低下することが報告されている [¬]. これ らより,極間および側面ギャップにおける気泡の滞留は,アスペクト比に影響を 与えていると考えられる.



L/D=2



図 3.16 アスペクト比ごとの観察

3.3.3 気泡占有部比較

ここでは、L/D=1、L/D=5の気泡占有部を比較した.図 3.17に比較した図を 示す.観察結果から気泡占有部は、加工穴が深くなればなるほど広くなる傾向に あることが分かった.L/D=1においては、加工穴が浅い.つまり、気泡が排出す るまでの経路が短いため、気泡は側面ギャップからすぐに排出される.しかし、 L/D=5 では、加工穴が深くなるため、気泡排出までの経路が長くなる.結果と して、気泡は、側面ギャップを抜けるまでに、より多くの時間を必要となり、気 泡が排出するよりも先に気泡同士が合一することで、蓄積され、大きな気泡とし て極間および側面ギャップに滞留すると考えられる.





L/D=1 L/I 図 3.17 気泡占有部比較

3.3.4 気泡の合一

放電加工において,多くの気泡は極間で生成される.このため,加工穴が深く なるにつれて気泡は,極間および側面ギャップからすぐに抜け出せなくなる.こ こでは,L/D=5 とし,超音波振動付与有無しにおける気泡挙動を観察した.超 音波振動付与無しにおける観察結果を図 3.18 に示す.図 3.18(1)の気泡は,図 3.18(3)に示すように時間が経過すると一つの大きな気泡となっている.気泡の 合一は,気泡の占める範囲の増加を引き起こし,気中雰囲気を作り出す.このた め,極間距離が減少し,短絡が多くなり,加工効率および加工精度を低下させる と考えられる.また,加工液が占めていた範囲の減少と移動を制限された加工屑 によって加工屑の濃度が増大すると考えられる.



(1) t





(2) t+0.5s 図 3.18 気泡の合一

(3) t+1.0s

3.3.5 放電波形

ここでは,超音波振動無しで L/D=5 における放電波形について観察した.連続放電の波形および各時間における側面ギャップを観察した結果を図 3.19 に示す.

放電開始直後に極間で形成された気泡が側面ギャップに現れ,徐々に大きく なり側面ギャップを占めていく様子を観察することができた.気泡が極間およ び側面ギャップを大きく占める約 12[s]~16[s]で,短絡が起こっている.図 3.18(3)のように気泡が滞留してしまうことで,極間および側面ギャップに気泡 が流れ込まず,気中雰囲気を作り出し,極間距離を減少させ,長時間の短絡を引 き起こしている.その後,基準電圧を 60[V]に設定しているため,電極が上に引 き戻され,再び 100[V]の電圧がかかっている.



図 3.19 放電波形

3.3.6 底面部と側面部の関係 超音波振動付与無し

アスペクト比向上に直接寄与するのは,底面部の放電である.そのため,ここ までの観察において,底面部と側面部の関係を考察し,概略図を図 3.20 に示す. (1)放電が開始されると底面部で小さな気泡が発生(2)気泡が膨張し,加工面の淵 に達すると(3)気泡は底面から抜け側面部に現れる.その後再び放電が開始,(4) 膨張,淵に達し,排出されるが,(5)側面ギャップでは気泡が滞留しており,さら に気泡の合一が進む.(6)これが繰り返されることにより側面部に加工液が流入 できなくなり,底面部においても加工液が流入せず,極間の気中雰囲気が解消さ れない.このため,加工液流入がアスペクト比向上に重要となる.



3.4 結言

本章では、ハイスピードマイクロスコープとアクリル加工槽を用い、放電加 工中の極間および側面ギャップを観察した.本章で得られた内容を以下にまと める.

- (1) 側面ギャップにおいて、気泡は加工屑排出に影響を与える.
- (2) L/D=5 における極間および側面ギャップの気泡の滞留が、実加工における L/D=5 付近での加工速度低下への影響の可能性を示した.
- (3) 加工穴が深くなると排出までの経路が長くなるため,気泡占有部が拡大する 傾向にある.
- (4) 加工穴が深くなると、気泡はほかの気泡と合一し、一つの大きな気泡となる。そして、側面ギャップにおける気泡占有部を拡大させ、気中雰囲気をつくりだす。
- (5) 短絡時に極間および側面ギャップが気泡で満たされていることを確認した.

第4章 超音波振動付与放電加工

4.1 緒言

4.1.1 底面部と側面部の関係 超音波振動付与有り

ここでは, USV を付与した際の底面部と側面部の関係を考察し, 概略図として図 4.1 に示す.

3.3.6 項と同様,(1)放電が開始されると底面部で小さな気泡が発生,(2)気泡が 膨張し,加工面の淵に達すると(3)気泡は底面から抜け側面に現れる.USV によ って縦方向に加工液を攪拌しているため,気泡が上昇しやすい状態であり,気泡 が合一しにくい.再び放電が開始して,(4)膨張,底面の淵に達すると(5)気泡が 排出し,上昇が繰り返されるため,(6)底面部および側面部に加工液が流入しや すい状態になり,極間の気中雰囲気を解消できると考えられる.



4.2 実験装置·方法

4.2.1 超音波振動付与装置概要

ここでは、電極および加工液へ超音波振動を付与し、効果を検証する.電極への超音波振動装置の概要を図 4.2 に、加工液への超音波振動付与装置概要を図 4.3 に示す.



図 4.2 電極への超音波振動付与概略図



図 4.3 加工液への超音波振動付与概略図

以下に(1)超音波カッターの図 4.4 を示し、その仕様を表 4.1 に示す。.

(1) 超音波カッター



図 4.4 Z0-41

表 4.1 超音波カッター	・の仕様
---------------	------

メーカ	エコーテック株式会社
型式	Z0-41
種類	超音波カッター
発振周波数	40[kHz]

4.3 実験結果および方法

4.3.1 電極に超音波振動付与

深さ 1[mm]で超音波振動付与有無での気泡の挙動を観察した. それぞれの観 察結果を図 4.5 に示す. 超音波振動付与無しでは,(1)放電開始後,(2)1.2s 後は 小さな気泡が発生,徐々に気泡が合一していき,(4)1.6s 後には気泡が極間を大 きく占めている様子が確認された. 超音波振動付与有りでは,放電開始から, (2)1.2s 後ギャップから気泡が抜けていく様子が確認できた. また,極間に気泡 の存在は確認できなかった.(3)1.4s 後,(4)1.6s 後も同様であった. これは,超 音波振動のキャビテーション効果によって気泡の崩壊が促されたためだと考え られる. このような超音波振動付与の効果によって,気泡の残留がなくなり,加 工初期において,加工効率が向上すると考えられる.



図 4.5 加工初期における極間の観察

側面ギャップでの気泡の滞留を解消するために, L/D=5 における放電加工中 に、超音波振動を付与した加工を試みた. 図 4.6 に、超音波振動付与における 気泡挙動の観察結果を示す. 超音波振動無しの穴加工では, 図 3.16 L/D=5 (4) に示したように、時間が経過しても合一した気泡は、側面ギャップに滞留したま まであった.一方,超音波を付与することで、図 4.6 (3)に示すように、気泡が 抜けている様子が確認された.ある程度大きくなった気泡は,超音波振動付与に よるキャビテーション効果では崩壊しなかった. そのため, 正面から見える側面 ギャップに気泡が滞留している. 超音波振動を付与すると, キャビテーション効 果だけではなく、電極が振動することによるポンピング効果も発生する. キャビ テーション効果によって崩壊しなかった気泡は,ポンピング効果が作り出す加 工液の流れによって, 流動され, 深さ基準線に達することで, 排出されると予想 される. また, 別の撮影では, 図 4.6(a)~(c)のように観察することができた. 図 4.6(1)~(3)では、図の下部で気泡の滞留が観察されたが、図 4.6(a)~(c)では、気 泡の滞留は観察されなかった.これは、キャビテーションによる気泡の崩壊に加 え、ポンピング効果が効率的に働き、気泡が合一する前に、側面ギャップから排 出していると考えられる. 図 4.6(1)~(3)の裏側では, 図 4.6(a)~(c)のように気泡 が滞留しない状態になっていると考えられる. そのため, 極間および側面ギャッ プに加工液が流れ込み,超音波振動付与中において,L/D=5 を超えても加工が 進んでいると考えられる.



図 4.6 電極への超音波振動付与

4.3.2 加工液に超音波振動付与

観察結果を図 4.7 に示す.加工液に超音波振動を付与することでも、アスペクト比が向上することが確認されている ⁸. 図 4.7(3)に示すように気泡の排出が確認された.超音波振動によるキャビテーション効果で,加工液が攪拌され,気泡が排出したと考えられる.しかし,電極への超音波振動付与と異なり,加工液に超音波振動を付与したときは、別の撮影でも極間および側面ギャップに気泡の滞留が確認された.これは、深さ基準線付近の加工液は、超音波振動によって攪拌されているが、加工穴底部においては、超音波振動が減衰し、加工液攪拌の影響が小さくなることで気泡の排出が促されずに、合一し、滞留していると考えられる.



(1)t
 (2)t+0.05s
 (3)t+0.1s
 図 4.7 加工液への超音波振動付与

4.4 第4章 結言

本章では、電極および加工液に超音波振動を付与し、その効果を検証した。 本章で得られた内容を以下にまとめる.

- (1) 電極に超音波振動を付与することで、気泡の排出が促進する.
- (2) 加工液に超音波振動を付与することで、気泡の排出が促進する.ただし、 側面ギャップの滞留が確認されているため穴底部において、超音波振動減 衰の可能性がある.

第5章 回転電極放電加工

5.1 緒言

電極を回転させることで、加工液による加工屑の排出や極間に加工液が流れ こみやすくなることによって、極間の冷却が促進され、集中放電や異常放電、短 絡が抑制されると報告されている⁹⁾.ここでは、側面ギャップにおける効果を検 証する。

5.2 実験装置·方法

5.2.1 回転付与装置概要

本装置では、動力伝達の方法として非接触方式を採用した.非接触伝達機構の 概略図を図 5.1 に示す.モーターの動力を、S極とN極が交互に着磁された磁 石を介して、主軸・電極へと伝える仕組みである.主軸にコレットチャックを用 いたので、電極を取り付けることで放電加工が可能になる.Zステージにより電 極を昇降し、X、Yステージにより被加工物を移動させる.

非伝達機構をしようするメリットとして、まず一つ目に、放電加工の際の放電 電流がモーターに流れないため、モーターを壊すことがない.

二つ目として、ギアなどと違い磨耗などがないため、半永久的に使用すること ができる.金属磨耗がないため、動力伝達部だけを見るとメンテナンスが少なく てすむことである.



使用した DC モーターを図 5.2 に、仕様を表 5.1 に示す.



図 5.2 DC モーター

メーカ	澤村電気工業株式会社
型式	MM16G
種類	DC モーター
定格出力	14W
回転速度	4000rpm
電圧	24V

表 5.1 DC モーターの仕様

5.3 実験結果および考察

5.3.1 回転電極実験結果

ここでは、L/D=5 において、電極に回転を加えた側面ギャップの観察を行っ た. 観察結果を図 5.3 に示す. 図 5.1(1)に示すように、モーターの軸とベアリ ングで支持した軸に磁気歯車を設置することで動力の伝達を行い、電極を高速 回転させる.また、一般に軸の重心が軸の中心線に、軸を工作することは困難で あり、若干の偏芯がある.このような軸が高速回転すると、偏芯により遠心力が 発生し、たわみが生じる.ある速度に達すると、遠心力が剛性抵抗力に打ち勝っ て、それに生じるたわみは偏芯を強め、軸の破壊に至る.この軸が破壊に達する 速度を危険速度という¹⁰⁾.本研究で使用する軸は、図 5.1(2)のような寸法であ る.ここでは、片持ち梁と仮定して、本電極の固有振動数と危険速度を式(5.1)、 式(5.2)より計算した.その結果、この電極の固有振動数 f[Hz]は、1742[Hz]であ り、危険速度 Nc[rpm]は、104546[rpm]であるため、本回転装置では危険速度に 至らない.ここでは、電極の回転数を 2000[rpm]とする.

$$f = \frac{\lambda^2}{2\pi l^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho S}} \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (5.1)$$
$$N_c = 60 \cdot f \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (5.2)$$

超音波振動を援用した高アスペクト比マイクロ加工に関する研究

観察の結果,図 5.3 に示すように図左上の部分から気泡の排出を確認した. また,側面ギャップに気泡の滞留が見られない.電極に回転を加えることで,危険速度に達する前にも電極が触れ回る.このとき,側面ギャップが変動することで,加工液のポンプ効果が働き,気泡が合一する前に排出を促しているものと考えられる.



図 5.3 回転電極

加工屑に着目した観察結果を図 5.4 に示す. 白実線で囲まれている部分が加 工屑が集中して存在している部分である.加工屑は,上下に少しずつ移動してい るものの,図の中央部の加工屑は,回転し続け,深さ基準線に達して抜けていく 様子を確認することはできなかった.超音波振動付与放電加工では,このような 加工屑の滞留は確認されなかった.超音波振動付与おいては、上下方向の運動が 主であるため,加工屑が上部もしくは下部に流れ、側面ギャップに滞留していな いと考えられる.一方,回転電極においては,回転方向の運動が主であるため, 加工屑が上昇していく要因が少ない.極間に存在する加工屑は,気泡によって持 ち上げられ排出するが,排出までの経路が長いと気泡側部から流れ出て,加工液 自体の回転流動の遠心力によって側面に滞留してしまうと考えられる.側面ギ ャップに存在する加工屑は二次放電を引き起こし,穴加工において真円度に影 響を与えると考えられる.また,観察の結果から加工屑が滞留しているのにもか かわらず,回転電極を用いるとアスペクト比の向上が確認されているのは,極間 および側面ギャップの気泡の滞留がないためであると考えられる.



図 5.4 回転電極における加工屑

5.4 結言

本章では、電極に回転を付与し、その効果を検証した。本章で得られた内容 を以下にまとめる.

(1) 電極に回転を付与することで気泡の排出が促進する.

(2) 加工穴中央部において加工屑の滞留を確認した.

第6章 結論

6.1 本研究のまとめ

本研究では、放電加工時の極間および側面ギャップの観察、工具電極、加工 液に超音波振動を付与、電極に回転を付与し、その効果を検証した.

1) 放電加工における側面ギャップの観察

加工屑排出において,気泡が大きな役割を果たしていることを確認した. また,L/D=5 では,気泡排出までの経路が長くなる.そのため,気泡が排 出する前に気泡同士が合一し,滞留する.その結果,極間および側面ギャ ップは,気中雰囲気状態を作り出し,加工効率および加工精度を低下させ ている.

- 2) 超音波振動付与放電加工
 - a) 電極への超音波振動

深さ1[mm]で,超音波振動によるキャビテーション効果によって気 泡の崩壊が促され,極間での気泡の合一が解消された.

L/D=5 では、キャビテーション効果による気泡の崩壊に加え、ポン ピング効果によって、極間および側面ギャップから排出された.この ため、加工液が流入することで、超音波振動付与加工における L/D=5 以上において、加工が進んでいると考えられる.

b) 加工液への超音波振動

L/D=5 において,超音波振動によるキャビテーション効果で加工液 が攪拌され,側面ギャップから気泡が排出した.しかし,加工穴底部 において,気泡の滞留が確認されたことから,超音波振動が減衰して いると考えられる. 3) 回転電極放電加工

L/D=5 において,電極が回転し,振れることによる側面ギャップの変動 でポンプ効果が働き,気泡の排出が促進された.また,加工液自体の回転 流動による遠心力によって,加工屑が加工穴中央部に滞留している様子を 確認した.

6.2 今後の課題

1) 加工穴底部での超音波振動減衰の可能性

加工液に超音波振動付与時,深さ基準線から気泡の排出がみられたが, 加工穴底部では,気泡の滞留が見られた.この滞留が,加工効率にどの程 度影響するか数値化されたデータが得られていない.例えば,超音波振動 付与有無での放電頻度の変化,周波数を変えることによる放電頻度の変化 を調査していく必要がある.

2) 気泡の排出効率

本研究では、条件を変えず超音波振動付与放電加工、回転電極放電加工 の気泡挙動の観察を行った.そのため、条件を変更した場合の気泡の排出 効率の違いについて、データが得られていない.例えば、周波数、回転数 を変えた際に排出された気泡を集め、体積を比較することで調査していく 必要がある.

3) 他形状電極での気泡挙動の観察

本研究では,無垢電極に超音波振動付与,回転付与を行った.そのため, ドリル型電極など,他形状での気泡挙動の調査はできていない.電極形状 を変えた気泡挙動の観察を行い,気泡排出効率がより良い形状を調査して いく必要がある.

参考文献

- [1] 池田光和, 単発放電により細隙に発生した気泡の挙動について 第1報, 電気加工学会, Vol.6, No.11(1972), pp.12-26
- [2] 今井進也,早川伸哉,糸魚川文,中村隆,放電加工の極間隙における気泡の 合一と加工現象の関係,電気加工学会誌, Vol.48, No.117(2014), pp.22-27
- [3] 北村朋生,国枝正典,透明体電極を用いた放電加工極間現象の直接観察,精 密工学会誌, Vol.81, No.11, (2015)pp.983-986
- [4] S.Hayakawa, S.Yamada, F.Itoigawa, T.Nakamura, T.Kitamura,
 M.Yamanaka : Effect of Bubble Coalesence on Materials Removal Rate in Electrical Discharge Machining Process, IJEM, No.16(2011), pp.33-39
- [5] 小川仁,坂東和宏,常本佳生:放電加工における加工液超音波振動援用の効果(第1報),電気加工学会誌,Vol.41,No.98(2007),pp.163-168
- [6] 倉ヶ谷翼,花岡大生、山下健、永澤茂、福沢康、超音波援用放電加工における振幅の加工特性への影響,2014年度精密工学会春季大会,(2014),pp.1179-1180
- [7] 小川仁, 放電加工における超音波キャビテーションの効果, 電気加工学会 誌.Vol.51, No.127(2017), pp348-353
- [8] 夏恒,加工液への超音波振動付与による微細深穴放電加工特性の向上,精密 工学会誌, Vol.82.No.5, (2016), pp413-417
- [9] 矢萩優名,小谷野智広,国枝正典,楊暁冬,静電誘導給電による高速回転電 極を用いた微細放電加工,精密工学会誌 Vol.77, No, 4(2011)pp.394-399
- [10] http://d-engineer.com/Mechanics/frequency.html